

= 3

= US 2003/0228467



⑩ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

⑫ Offenlegungsschrift
⑩ DE 102 17 362 A 1

⑤ Int. Cl. 7:
B 82 B 3/00

DE 102 17 362 A 1

⑪ Aktenzeichen: 102 17 362.1
⑫ Anmeldetag: 18. 4. 2002
⑬ Offenlegungstag: 13. 11. 2003

⑦1 Anmelder:
Infineon Technologies AG, 81669 München, DE

⑦4 Vertreter:
Müller-Boré & Partner, Patentanwälte, European
Patent Attorneys, 81671 München

⑦2 Erfinder:
Liebau, Maik, Dr.rer.nat., 81735 München, DE;
Unger, Eugen, Dr.rer.nat., 86161 Augsburg, DE;
Düsberg, Georg, Dr.rer.nat., 80469 München, DE

⑦6 Entgegenhaltungen:
US200 2/00 25 374 A1
US200 2/00 20 841 A1
EP 10 96 533 A1
WO 02/0 54 505 A2
P.M. MORAN, u.a.: "Microscale lithography via
channel stamping...". In: APL 74,9 (1999),
S. 1332-1334;
K.H. CHOI, u.a.: "Controlled deposition of carbon
nanotubes....". In: Surface Science 462 (2000),
S. 195-200;

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen
Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑤4 Gezielte Abscheidung von Nanoröhren
⑤7 Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur gezielten Abscheidung von Nanoröhren, insbesondere Kohlenstoff-Nanoröhren, auf planaren Oberflächen unter Ausnutzung von Kapillarkräften durch Verwendung von mikrofluidischen Kapillarsystemen.

DE 102 17 362 A 1